

## EVG signs contract with PMT to supply maskless lithography equipment - January 24, 2024

PMT has ordered a LITHOSCALE® maskless exposure system from EVG. Incorporating EVG's MLE™ (maskless exposure) technology, LITHOSCALE addresses lithography needs for markets and applications that require a high degree of flexibility or product variation. LITHOSCALE tackles legacy bottlenecks by combining powerful digital processing that enables real-time data transfer and immediate exposure, high structuring resolution and throughput scalability. It is ideally suited for rapid prototyping, providing fast turnaround and R&D cycle times.



## EVG, 피엠티와 마스크리스 리소그래피 장비 공급 계약

발행원: 2024 O1 24 1421



<EVG 리소스케일 장비>

반도체 장비사인 EV그룹(EVG)는 피엔티에 마스크리스 노광 시스템 '리소스케일'을 공급한다고 24일 밝혔다.

리소스케일 장비는 피엔티가 첨단 메모리 웨이퍼 테스트용 프로브커드를 제조하는데 활용된다. 프로브커드는 반도체 동작을 검사하기 위해 참과 테스트 장비를 연결하는 장치다. 피엔티는 초소청정말기계기술(MEMS)을 기반으로 프로브커드를 만들고 있다.

프로브카드 제조를 위해서는 반도체 회로를 웨이퍼에 새기듯 노광 공정이 필요하다. 기존에는 회로가 세겨진 '포토마스크'에 빛을 투져시켰지만, 포토마스크 가격이 높아 비용 부담이 컸다. 특히 미세 공정으로 전환되고 복잡성이 커지먼서 마스크 제조에 필요한 시간과 비용도 함께 증가했다.

EVG 리소스케일은 마스크를 사용하지 않고 직접 노광 공정을 진행, 연구개발(R&D) 기간을 앞당기고 비용 부담을 즐일 수 있다. 노광 먼적 제한 없이 마스크를 실시간으로 전송, 즉시 노광 공정을 할 수 있는 기술 덕분이다. 높은 초점 심도와 고분해능으로 첨단 프로브카드 핵심인 고밀도 재배선 레이어(RDL)과 비아 연결이 가능하다.



파엠타는 충남 아산 본사에서 EVG 정비를 구축해 첨단 낸드-D램-고대약폭메모리(HBM) 테스트용 프로브카드를 제조할 계획이다. 조용호 패엠타 대표는 "미세 피지 프로브카드는 비용 중가 최소화가 필요하다"며 "기준 마스크 얼라이너(Mask Aligner)를 이용한 노광 공정을 EVG 마스크리스 노광 장비로 대체, 제조 비용 절감이 가능하고 공정 개발 속도 또한 단축할 수 있을 것"으로 기대했다.

https://www.etnews.com/20240124000234